

秋田工業高等専門学校		開講年度	平成30年度 (2018年度)		授業科目	建築デザイン演習 I	
科目基礎情報							
科目番号	0008			科目区分	専門 / 必修		
授業形態	演習			単位の種別と単位数	履修単位: 1		
開設学科	創造システム工学科 (土木・建築系)			対象学年	2		
開設期	前期			週時間数	2		
教科書/教材	プリント配布						
担当教員	井上 誠,鎌田 光明						
到達目標							
1. 建築設計で用いる基本的な製図方法と図面のきまり、表現方法を修得する。 2. 図面特有の情報伝達機能を修得する。							
ルーブリック							
	理想的な到達レベルの目安			標準的な到達レベルの目安		未到達レベルの目安	
評価項目1	作業内容を理解し、それを実行し、説明することができる。			作業内容を理解し、それを実行することができる。		作業内容を実行することができない。	
評価項目2	作業内容を理解し、適切な手法において実行し、完遂することが出来る。			作業内容を理解し、適切な手法において実行することが出来る。		作業内容を理解し、適切な手法において実行できない。	
学科の到達目標項目との関係							
教育方法等							
概要	建築設計で用いる基本的な製図方法と図面のきまり、表現方法を修得し、図面特有の情報伝達機能を修得する。						
授業の進め方・方法	各課題のはじめに授業を行い、演習形式を中心に行なう。提出物が合格点に達しない場合、再提出を課すことがある。						
注意点	合格点は50点である。総合評価は、各課題の評価の平均を全体の80%とし、授業態度を20%として総合的に行なう。特に、レポート・課題の未提出者は単位取得が困難となるので注意すること。						
授業計画							
		週	授業内容		週ごとの到達目標		
前期	1stQ	1週	授業ガイダンス 1 製図のきまりと基本的方法 (1) 製図用具とその使い方		基本的製図用具の種類と使い方がわかる。		
		2週	(2) 製図に用いる線の種類		製図用の線の種類と用法がわかる。		
		3週	(2) 製図に用いる線の種類		製図用の線の種類と用法がわかる。		
		4週	2 投影図法と立体表現の基礎 (1) 投影図法の基礎		投影図法の基礎を修得できる。		
		5週	(1) 投影図法の基礎		投影図法の基礎を修得できる。		
		6週	(2) 立体表現の基礎		階段の投影図の作成と陰影を用いた立体表現手法を修得できる。		
		7週	(2) 立体表現の基礎		階段の投影図の作成と陰影を用いた立体表現手法を修得できる。		
		8週	(2) 立体表現の基礎		階段の投影図の作成と陰影を用いた立体表現手法を修得できる。		
	2ndQ	9週	(2) 立体表現の基礎		透視図の基礎を修得できる。		
		10週	(2) 立体表現の基礎		透視図の基礎を修得できる。		
		11週	(2) 立体表現の基礎		透視図の基礎を修得できる。		
		12週	3 透視図法の基礎 (1) 一点透視図法の基礎		室内を想定した一点透視図法を修得できる。		
		13週	(1) 一点透視図法の基礎		室内を想定した一点透視図法を修得できる。		
		14週	(2) 二点透視図法の基礎		建物の外観を想定した二点透視図法を修得できる。		
		15週	(2) 二点透視図法の基礎		建物の外観を想定した二点透視図法を修得できる。		
		16週					
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標							
分類		分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週	
専門的能力	分野別の専門工学	建設系分野	製図	線と文字の種類を説明できる。	3	前2,前3	
				平面図形と投影図の描き方について、説明できる。	3	前4,前5	
				図の配置、尺度、表題欄、寸法と寸法線の規約について、説明できる。	3	前4	
		建築系分野	設計・製図	製図用具の特性を理解し、使用できる。	3	前1	
				線の描き分け(3種類程度)ができる。	3	前2	
				文字・寸法の記入を理解し、実践できる。	3	前3	
				図面の尺度・縮尺について理解し、図面の作図に反映できる。	3	前5	
				立体的な発想とその表現(例えば、正投象、単面投象、透視投象などを用い)ができる。	3	前6,前7,前8,前9,前10,前11,前12,前13,前14,前15	
評価割合							
	試験	発表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	0	0	0	20	0	80	100
基礎的能力	0	0	0	20	0	40	60

專門的能力	0	0	0	0	0	20	20
分野横断的能力	0	0	0	0	0	20	20